



一种长程面形测量装置

文献类型: 专利

作者 彭川黔; 何玉梅; 王劼

发表日期 2016-07-06

专利号 CN105737759A

著作权人 中国科学院上海应用物理研究所

国家 中国

文献子类 发明专利

英文摘要 本发明提供一种长程面形测量装置, 用于对待测光学器件的表面进行面形检测, 其包括移动光学头, 该移动光学头包括面光源、单孔屏、分束镜、傅里叶变换透镜及面阵探测器, 所述分束镜紧贴在所述单孔屏的上表面, 所述单孔屏设置在所述面光源一侧并与所述面光源呈一倾斜角度, 使面光源法线方向光束能通过单孔屏孔部分分束镜垂直反射到待测光学器件表面, 所述傅里叶变换透镜水平设置在所述分束镜上方, 所述面阵探测器水平设置在所述傅里叶变换透镜上方。本发明减少了测量不同角度时测量光束横移引入的系统误差, 从而提高了测量精度。

公开日期 2016-07-06

申请日期 2016-02-24

语种 中文

源URL [http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/33709] [↓](#)

专题 上海应用物理研究所_中科院上海应用物理研究所2011-2017年

推荐引用方式 彭川黔,何玉梅,王劼. 一种长程面形测量装置. CN105737759A. 2016-07-06.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [上海应用物理研究所](#)

浏览

23

下载

4

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。